

## SEMPREP2

定位制备  
高品质的 SEM 用样本



- 标准配置高能离子枪用于快速抛光，或选配超高能量离子枪
- 标准配置低能量离子枪适用后处理的表面无损细抛和清洁
- 具备不同角度的剖面切削样品台，便于预设切削角度制备横截面样品
- 具备表面抛光样品台，SEM 或 EBSD 样本的抛光或最终阶段的细抛和清洁
- 可选液氮制冷样品台和其他配件，应用于多种类样本
- 嵌入式计算机系统，全自动设定操作，并可切换手动模式
- 高分辨率彩色相机实现实时监控抛光过程

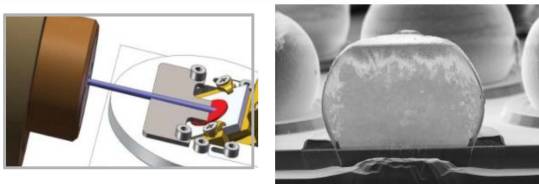
### 概述

全自动离子研磨仪 SC-2100 配备高低能量两支离子枪。标准配置的高能离子枪进行快速切削。低能量离子枪用于表面的精细抛光和清洁，制备适用出半导体故障分析和其他分析的 SEM 用横断面样品。SC-2000 还可用于改善和清洁机械抛光后的 SEM 样品，制备精致的无损伤样本应用于 EBSD 分析。可选配更强大的 16 keV 超高能量离子枪用于超硬材料和更快速切削样本。可选配液氮或 Peltie 冷却台，保护对热敏感的样品。具备的气锁系统，利于大通量样本快速交换样品，显著缩短换样时间。完全自动化操作系统，可编程，保存和再现制样参数，避免不同操作者的造成的人为差异，保证制备高品质无人为假象的样本，用于 SEM / EBSD 等成像和分析。

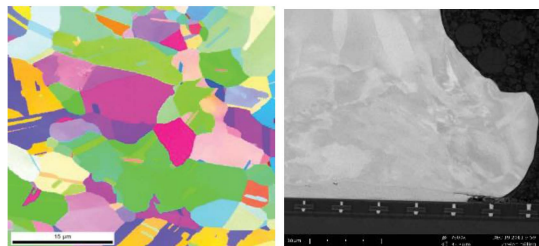
### 应用

#### 离子束剖面切削

适合制备 SEM / EBSD 成像和微量分析的不同质量构成的固态材料的平面横截面。



Sn-Ag 焊接的球栅阵列 (BGA)

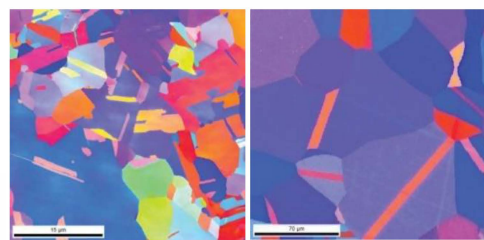
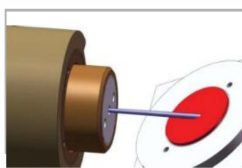


铜切割片表面的 EBSD 像 (OIM)

金属引线键合

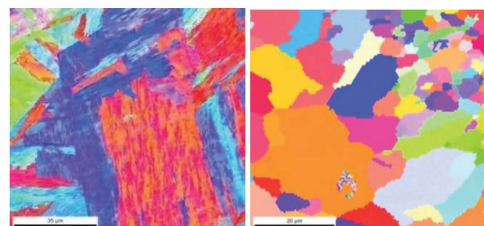
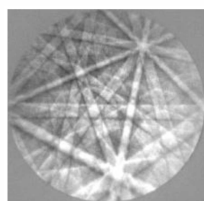
#### 离子束表面抛光

适合制备电子背散射衍射分析 (EBSD) 和定向成像显微分析法 (OIM) 的样品。



铜

镍



马氏体钢

石灰岩



